

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

К.т.н. В. М. Чмилё

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

*К.т.н. Н. М. Вакив (г. Львов)
Д.т.н. В. Н. Годованюк (г. Черновцы)
К.т.н. А. А. Дашковский (г. Киев)
Н. В. Кончиц (г. Киев)
Д.т.н. В. П. Малахов (г. Одесса)
Д.ф.-м.н. В. Ф. Мачулин (г. Киев)
В. А. Проценко (г. Киев)
Е. А. Тихонова (г. Одесса)*

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

*Д.т.н. А. А. Ащеулов (г. Черновцы)
Д.т.н. В. В. Баранов (г. Минск)
К.т.н. Э. Н. Глушеченко,
зам. гл. редактора (г. Киев)
Д.т.н. В. В. Данилов (г. Донецк)
Д.т.н. В. Т. Дейнеса (г. Одесса)
Д.ф.-м.н. В. А. Дроздов (г. Одесса)
К.т.н. И. Н. Еришчой,
зам. гл. редактора (г. Одесса)
К.т.н. А. А. Ефименко,
ответственный секретарь (г. Одесса)
Д.т.н. С. Ю. Лузин (г. С.-Петербург)
К.т.н. И. Л. Михеева (г. Киев)
К.т.н. Ю. Е. Николаенко (г. Киев)
Д.ф.-м.н. В. В. Новиков (г. Одесса)
К.ф.-м.н. А. В. Рыбка (г. Харьков)
К.т.н. В. В. Рюхтин (г. Черновцы)
Д. ф.-м. н. М. И. Самойлович (г. Москва)
Д.ф.-м.н. П. В. Серба (г. Таганрог)
Д.х.н. В. Н. Томашик (г. Киев)
Д.ф.-м.н. О. И. Шпотюк (г. Львов)*

УЧРЕДИТЕЛИ

Министерство промышленной политики
Украины
Институт физики полупроводников
им. В. Е. Лашкарёва
Научно-производственное
предприятие «Сатурн»
Одесский национальный
политехнический университет
Издательство "Политехпериодика"

Одобрено к печати Ученым советом ОНПУ
(Протокол № 8 от 22.04.08)

Современные электронные технологии

Фракталы, скейлинг и дробные операторы как основа новых методов обработки информации и конструирования фрактальных радиосистем. *Потанов А. А.* 3

Электронные средства: исследования, разработки

Сопротивление контактов тонкопленочного резистора. *Спириин В. Г.* 20

Реализация арифметических операций с комплексными числами на ПЛИС. *Опанасенко В. Н., Лисовый А. Н., Сахарин В. Г.* 24

Сенсоэлектроника

Датчики на поверхностных акустических волнах для дистанционного контроля температуры. *Катаев В. Ф., Багдасарян А. С., Карапетьян Г. Я., Днепровский В. Г.* 31

Функциональная микро- и наноэлектроника

Особенности проектирования внутренних цепей питания микромощных БИС на основе элементов инжекционной логики. *Белоус А. И., Емельянов В. А., Сякерский В. С., Силин А. В.* 33

Технологические процессы и оборудование

Химическое осаждение из газовой фазы гетеро- и наноструктур соединений III–V. *Ворошин В. А., Губа С. К., Курило И. В.* 36
Информационные параметры для реализации адаптивной зарядки вторичных химических источников тока. *Житник Н. Е., Миропольский Ю. Л., Пласкин С. В., Погорелая Л. М., Соколовский И. И.* 40

Приборно-технологическое моделирование автоэмиссионных кремниевых микрокатодов. *Дружинин А. А., Голота В. И., Козут И. Т., Сапон С. В., Ховерко Ю. М.* 43

Макет экспериментальной установки для исследования пространственно-временного интегрирования в акустооптической среде. *Рудякова А. Н., Литинский А. Ю., Данилов В. В.* 50

Испаритель для термического напыления материалов в вакууме. *Босый В. И., Кохан В. П., Рахманов Н. М.* 56

Материалы электроники

Прогнозирование диэлектрических свойств некристаллизующейся моноармированной полиматричной стеклокерамики. *Дмитриев М. В., Еришчой И. Н., Панов Л. И., Панова Е. Л.* 58
Влияние исходных дефектов на распределение механических напряжений и деформаций при окислении кремния. *Кулинич О. А., Смынтына В. А., Глауберман М. А., Чемересюк Г. Г., Яцуцкий И. Р.* 62

Библиография

Новые книги 32, 35, 49, 55, 57

В портфеле редакции 32

Выставки. Конференции 30, 2-я, 3-я, 4-я стр. обл.